# シリコン系アモルファス半導体における水素やフッ素の入り方と欠陥


| メタデータ | 言語: Japanese |
| --- | --- |
| | 出版者: |
| | 公開日: 2023-03-13 |
| | キーワード (Ja): |
| | キーワード (En): |
| | 作成者: 清水, 立生, Shimizu, Tatsuo |
| | メールアドレス: |
| | 所属: |
| URL | https://doi.org/10.24517/00068228 |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

# シリコン系アモルファス半導体における水素やフッ素の入り方と欠陥

Research Project

All

## Project/Area Number

59540176

## Research Category

Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)

## Allocation Type

Single-year Grants

## Research Field

固体物性

## Research Institution

Kanazawa University

## Principal Investigator

**清水 立生** 金沢大学, 工学部, 教授

## Project Period (FY)

**1984**

## Project Status

Completed (Fiscal Year 1984)

## Budget Amount *help

**¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)**
Fiscal Year 1984: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)

**URL:** https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-59540176/

Published: 1987-03-30 Modified: 2016-04-21